497413-2026 - Wettbewerb

Deutschland – Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
OJ S 136/2026 17/07/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
E-Mail: wahl@ifos.uni-kl.de
Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber subventionierten Auftrag vergibt
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
Beschreibung: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn. Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".
Kennung des Verfahrens: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb
Interne Kennung: 25-1696-1707
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM). Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellose entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium

"Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellose hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Probentransfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.5. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 2
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 2

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten Verpflichtungen:
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung:
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung:
Betrug:
Korruption:
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern:
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen:
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen:
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen:
Zahlungsunfähigkeit:
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter:
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften:
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten:
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren:
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens:
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen:
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren:

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)
Beschreibung: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.
Interne Kennung: 1

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Lieferungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis
Bezeichnung: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)
Beschreibung: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

Kriterium:

Art: Qualität
Bezeichnung: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)
Beschreibung: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix

Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06. Wertungsmatrix.pdf."
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents

Ad-hoc-Kommunikationskanal:

URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 77 Tage

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. Los: LOT-0002

Titel: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
Beschreibung: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und

Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.
Interne Kennung: 2

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Lieferungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis
Bezeichnung: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)
Beschreibung: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

Kriterium:

Art: Qualität
Bezeichnung: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)
Beschreibung: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06. Wertungsmatrix.pdf."
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 50

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 77 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der

Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Registrierungsnummer: UStID DE148647541
Postanschrift: Trippstadter Straße 120
Stadt: Kaiserslautern
Postleitzahl: 67663
Land, Gliederung (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Land: Deutschland
E-Mail: wahl@ifos.uni-kl.de
Telefon: +49 631205730
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Registrierungsnummer: UStID DE267215971
Postanschrift: Kramergasse 4
Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01067
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland
E-Mail: l.moerchen@eureos.de
Telefon: +49 39156286912
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Registrierungsnummer: 07-0001801100000-05
Postanschrift: Stiftsstraße 9
Stadt: Mainz

Postleitzahl: 55116
Land, Gliederung (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefon: +49 6131162234
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 497413-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 136/2026
Datum der Veröffentlichung: 17/07/2026